2P175

大気圧窒素・空気中 ArF エキシマーレーザーによる低濃度 N_2O の分解過程に関する研究

(九大院総理工¹・九大先導研²・CREST³)

仙田 慎1, 迫 寬之1, 野田 健二1, 辻 剛志1-3, 辻 正治1-3

【緒言】

化石燃料の燃焼ガス中や車の排ガス中に含まれる亜酸化窒素 (N_2O) は、温暖化やオゾン層の破壊等、地球環境問題に大きく関わり、その挙動が注目されている。現在、大気環境浄化のための NO_X 処理プロセスとして三元触媒等の還元法があげられるが、 N_2O は O_2 や SO_X の存在下で触媒が被毒を受け、処理が困難となる。以前に我々は放電プラズマによる N_2O の分解処理過程を研究し、放電プラズマを使用すれば窒素中では高効率で N_2O を分解処理可能なことを見出した。 $^{1)}$ しかし、少量の酸素を添加すると分解率は著しく低下し、また $N_2O/O_2/N_2$ の気相放電反応でNOが発生し、 O_2 存在下ではNOX除去が困難なことがわかった。その後我々は波長193 nmにおいて N_2O の光吸収係数が O_2 と比べて 300 倍大きいことに着目し、ArFエキシマーレーザーを用いた大気圧窒素・空気中での N_2O の選択的な光分解処理プロセスの開発研究を行っている。今回は従来より低 N_2O 濃度(100 ppm)での測定もFTIRを用いて行った。得られた実験結果とモデル計算値とを比較することによって、その分解機構を考察した。 $^{2,3)}$

【実験】

図 1 に実験装置図を示す。 N₂O/ N₂又はN₂O/ N₂/O₂混合ガスを反応セル内に導入し、系内を大気圧に保った後、ArF エキシマーレーザー(波長:193 nm、エネルギー:40~120 mJ/pulse、繰り返し周波数:5 Hz、照射時間:1~30分)を照射した。照射後のN₂Oの分解率、N₂, O₂, NOの生成率はガス分析用質量分析

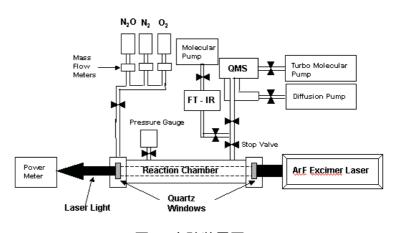


図 1. 実験装置図

計(QMS)、フーリエ変換赤外吸収スペクトル(FT-IR)分析法を用いて決定した。

【結果と考察】

図 2,3 に、大気圧空気中で N_2 Oを 5 %(50000 ppm)含む系と 0.01 %(100 ppm)含む系に 193 nm光を照射したときの N_2 Oの残留率、 N_2 , O_2 ,NOの生成率の照射時間依存性をそれぞれ示す。図 2 より N_2 Oを 5 %(50000 ppm)含む系では、15 分で約 90%の N_2 Oが主に N_2 と O_2 に分解し、有害なNOの発生量を 10 %以下に抑制できることがわかった。また、図 3 より N_2 Oを 0.01 %(100 ppm) 含む系では、 N_2 Oが 10 分で、ほぼ完全に無害な N_2 と O_2 に分解し、NOは全く生成しな N_2 Cが 100 かった。

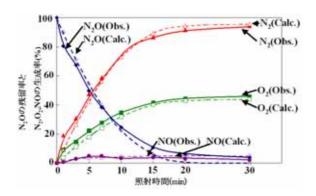


図 2. N_2 0を 5 %含む系におけるレーザー照射時間に対する N_2 0の残留率、 N_2 , O_2 ,N0生成率の実験結果と計算結果

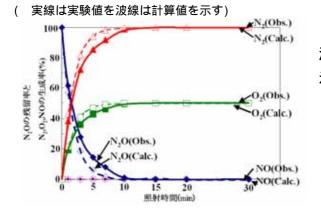


図 3. N_2 0を 100 ppm含む系におけるレーザー 照射時間に対する N_2 0の残留率、 N_2 , O_2 ,N0生成率 の実験結果と計算結果

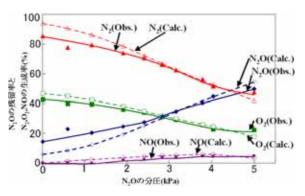


図 4. N_2 0を 193 nm光を 5 分照射したときの N_2 0分圧に対する N_2 0残留率、 N_2 , O_2 ,N0生成率の実験結果と計算結果

図 4 に、大気圧空気中で N_2O の濃度を0.01~%(0.01~kPa)から5~%(5.06~kPa)まで変化させ、193~nm光を $5~分間照射したときの<math>N_2O$ 残留率、 N_2,O_2,NO の生成率の N_2O 分圧依存性をそれぞれ示す。 N_2O 濃度が薄いと、 N_2O の残留率は低くなり、NOの生成率はより低くなることが確認された。

図 2-4 の波線は以下のN₂O光分解(1)とO(¹D)との反応(2)でN₂Oが分解する過程を中心に、全部で 27 個の気相素反応を考慮した計算結果である。モデル計算結果は実測結果をほぼ再現し、分解モデルの妥当性が示唆された。

$N_2O + h$	$N_2 + O(^1D)$	(1)
$O(^{1}D) + N_{2}O$	$N_2 + O_2$	(2a)
	2NO	(2b)
$O(^{1}D)+M$	$O(^3P)+M$	(3)
$2O(^{3}P)+M$	$O_2 + M$	(4)
$O(^{1}D)+NO$	$O(^3P)+NO$	(5a)
	$O_2+N(^4S)$	(5b)
$N(^4S)+NO$	$N_2 + O(^3P)$	(6)
$M=N_2, O_2$		

本研究では大気圧窒素・空気中でArFエキシマーレーザーを用いた、選択的な N_2 Oの光分解処理プロセスの開発を行い、 N_2 Oを酸素存在下の空気中でも無害な N_2 と O_2 に高効率で、高分解処理が可能なことが示唆された。さらに N_2 O光分解過程での有害なNOの生成を抑制できた。

また $193 \text{ nm光を用いた本手法は、高価な触媒を使用することなく、実際の化石燃料の燃料ガスや自動車の排ガス中に含まれる<math>ppm$ レベルの低濃度 N_2 Oの光分解処理に対してより有効なことが確認された。

[参考文献]

- 1) M. Tsuji, J. Kumagae, K. Nakano, T. Matsuzaki, and T. Tsuji, Appl. Surf. Sci., 217, 134 (2003)
- 2) M. Tsuji, J. Kumagae, T. Tsuji, and T. Hamagami, J. Hazard. Mater., 108, 189 (2004)
- 3) M. Tsuji, H. Sako, K. Noda, M. Senda, T. Hamagami, and T. Tsuji, Chem. Lett., 34, 812 (2005).